



<p>(51) 国際特許分類 C23C 16/44, H01L 21/285</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/42235</p> <p>(43) 国際公開日 2000年7月20日(20.07.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP00/00173</p> <p>(22) 国際出願日 2000年1月17日(17.01.00)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平11/9529 1999年1月18日(18.01.99) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED)[JP/JP] 〒107-8481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 田中 澄(TANAKA Sumi)[JP/JP] 〒400-0062 山梨県甲府市池田1-7-34 Yamanashi, (JP) 米田昌剛(YONEDA, Masatake)[JP/JP] 〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条2000 グローブハウス301 Yamanashi, (JP)</p> <p>(74) 代理人 鈴江武彦, 外(SUZUYE, Takehiko et al.) 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴葉内外国特許法律事務所内 Tokyo, (JP)</p>	<p>(81) 指定国 KR, SG, US</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>	
<p>(54) Title: FILM FORMING DEVICE</p> <p>(54)発明の名称 成膜装置</p> <div data-bbox="231 758 817 1056"> </div> <p>(57) Abstract</p> <p>A film forming device, characterized by comprising a container forming a processing chamber in which an object is processed, a loading table which is provided in the processing chamber and on which the object is loaded, a first heating device which is provided on the loading table and heats the object loaded on the loading table, a first gas feeding part which is provided in the container and feeds into the processing chamber a processing gas for forming a metallic film layer with high melting point on the object loaded on the loading table, a movable clamp holding the object on the loading table by pressing the peripheral part of the object, a second heating device which is formed separately from the clamp and indirectly heats the clamp, a gas flow path formed at least between the clamp and the second heating device when the clamp is moved to a position where it presses the object, and a second gas feed part feeding a back side gas to the gas flow path.</p>		